

○経済産業省告示第 号

貿易関係貿易外取引等に関する省令（平成十年通商産業省令第八号）第十条第三項の規定に基づき、令和六年経済産業省告示第百七十八号（貿易関係貿易外取引等に関する省令第十条第三項の規定に基づく重要管理対象技術を提供することを目的とする取引を行おうとする者に報告を求める事項）の一部を次の表のように改正し、令和 年 月 日から施行する。

令和 年 月 日

経済産業大臣 名

（傍線部分は改正部分）

改正後	改正前
二 この告示において「重要管理対象技術」とは、外国為替令（昭和五十五年政令第二百六十号）別表の一六の項の中欄に掲げる技術のうち	二 この告示において「重要管理対象技術」とは、外国為替令（昭和五十五年政令第二百六十号）別表の一六の項の中欄に掲げる技術のうち

ち、当該技術を提供した後に、当該技術の提供を受けた者が当該技術の内容とする情報を適切に管理しない場合において、省令第九条第二項第七号ロ若しくはニ又は第八号ロ若しくはニに規定するおそれが生じる技術であつて、次に掲げるものをいう。

イ・ロ (略)

ハ 半導体集積回路の製造に用いられるものの設計又は製造に係る技術であつて、次に掲げるもの

(一) (四) (略)

ち、当該技術を提供した後に、当該技術の提供を受けた者が当該技術の内容とする情報を適切に管理しない場合において、省令第九条第二項第七号ロ若しくはニ又は第八号ロ若しくはニに規定するおそれが生じる技術であつて、次に掲げるものをいう。

イ・ロ (略)

ハ 半導体集積回路の製造に用いられるものの設計又は製造に係る技術であつて、次に掲げるもの

(一) (四) (略)

(五) ウエハの処理のためのステップアンドリピート方式又はステップアンドスキャン方式であり、かつ、光学方式の露光装置(光源の波長が二四八ナノメートル以下のものに限る。)に使用されるように設計された光源の設計又は製造に必要な技術 (六) 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置若しくは試験装置に用いられるセラミックス製のチャックの設計又は製造に必要な技術	
ニ・ホ (略)	(新設) ニ・ホ (略)

へ 蓄電池及びその製造に用いられるものの設計又は製造に係る技術であつて、次に掲げるもの

(一) ～ (三) (略)

(四) リチウムイオン電池の材料として使用されるリン酸マンガン鉄リチウム正極活物質(マンガン又は鉄以外の元素をドーブ処理したものを含む。)の設計又は製造に係る技術

(五) ハイブリッドスーパーキャパシタ(電気二重層キャパシタに類する出力性能及び

へ 蓄電池及びその製造に用いられるものの設計又は製造に係る技術であつて、次に掲げるもの

(一) ～ (三) (略)

(新設)

(新設)

蓄電池に類するエネルギー密度を有する製品)の設計又は製造に係る技術(エネルギー密度、出力性能及び耐久性の向上に資する技術に限る。)

トゝヌ (略)

ル 光学部品及びその製造に用いられるものの設計又は製造に係る技術であつて、次に掲げるもの

(一)・(二) (略)

(三) 光学ガラス又は光学結晶であつて、次のいずれかに該当するものの設計又は製造

トゝヌ (略)

ル 光学部品及びその製造に用いられるものの設計又は製造に係る技術であつて、次に掲げるもの

(一)・(二) (略)

(新設)

に係る技術

1 四三六ナノメートルの波長の光を透過させたときの内部透過率が厚さ一センチメートル当たり九九%以上のものであつて、六三二・八ナノメートルの波長の光を透過させたときの屈折率の変動が一〇〇万分の二〇以下であり、かつ、複屈折が厚さ一センチメートル当たり二〇ナノメートル以下であるもの

2 三六五ナノメートルの波長の光を透過させたときの内部透過率が厚さ一センチ

メートル当たり九九%以上のものであつて、六三二・八ナノメートルの波長の光を透過させたときの屈折率の変動が一〇〇万分の二〇以下であり、かつ、複屈折が厚さ一センチメートル当たり二〇ナノメートル以下であるもの

3 二四八ナノメートルの波長の光を透過させたときの内部透過率が厚さ一センチメートル当たり九九%以上のものであつて、六三二・八ナノメートルの波長の光を透過させたときの屈折率の変動が一〇

○万分の二〇以下であり、かつ、複屈折が厚さ一センチメートル当たり一〇ナノメートル以下であるもの

4 | 一九三ナノメートルの波長の光を透過させたときの内部透過率が厚さ一センチメートル当たり九九%以上のものであつて、六三二・八ナノメートルの波長の光を透過させたときの屈折率の変動が一〇○万分の二〇以下であり、かつ、複屈折が厚さ一センチメートル当たり一〇ナノメートル以下であるもの

(四) (三)に規定する光学ガラス又は光学

(新設)

結晶を用いた光学レンズであつて、ウエハ
ーの処理のためのステップアンドリピート
方式又はステップアンドスキャン方式であ
り、かつ、光学方式の露光装置に用いるこ
とができるものの設計又は製造に係る技術
ヲ 工作機械の製造に用いられるものの設計又

(新設)

は製造に係る技術であつて、次に掲げるもの
(一) 輪郭制御をすることができる軸数が五
以上の工作機械に用いることができるサー
ボ機構(数値制御装置、サーボアンプ、サ

ーボモータ及びエンコーダの集合体であつて、当該数値制御装置により発信される制御指令信号に基づき自動的に誤差を補正しながら駆動することを可能とするよう構成されたものをいう。）の設計又は製造に係る技術

(二) (一)に規定するサーボ機構に使用されるように設計された数値制御装置、サーボアンプ、サーボモータ又はエンコーダの設計又は製造に係る技術